

MPI TS200-THZ | 200 mmマニュアル型プローブシステム

正確なミリ波、THzおよびロードフル測定の為に設計されたプローブシステム

顕微鏡および光学系

- 単眼鏡筒型 MPI SZ12, MZ12
- 最高12倍 ズーム、90 mmの作動距離
- 最高 1.68 μm 分解能
- HDMI カメラ・モニターインターフェース、PC不要

顕微鏡マウント/移動機構

- 高精度顕微鏡のための安定マウント
- 50 x 50 mm または 80 x 80 mm リニア XY 移動機構
- 90° チルト機構

プローブ・プラテン

- DCバイアス用4 ポートブリッジまたは4ポートRF
- ミリ波、THz用大型マイクロポジショナ用に特別設計
- RFマイクロポジショナ用角型調整器

Probe Hover Control™を備えたプラテンリフト機構

- コンタクト、セパレーション (300 μm)、安全ローディング (3 mm) の3つの独立位置に加え、アライメントとして 50 / 100 / 150 μm のいずれかの高さの停止位置を設定可能
- ロード位置における安全ロック機能
- 安定した接触を実現する、繰り返し精度 $\pm 1 \mu\text{m}$ の自動コンタクト位置

小型設計

- ベンチトップ型
- 防振ベース組込
- 使い易さを考慮した高さ設計
- ミリ波、THz、ロードフル測定に最適

マイクロポジショナ

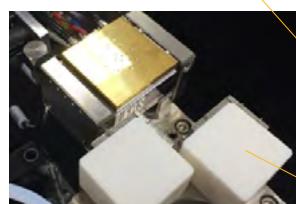
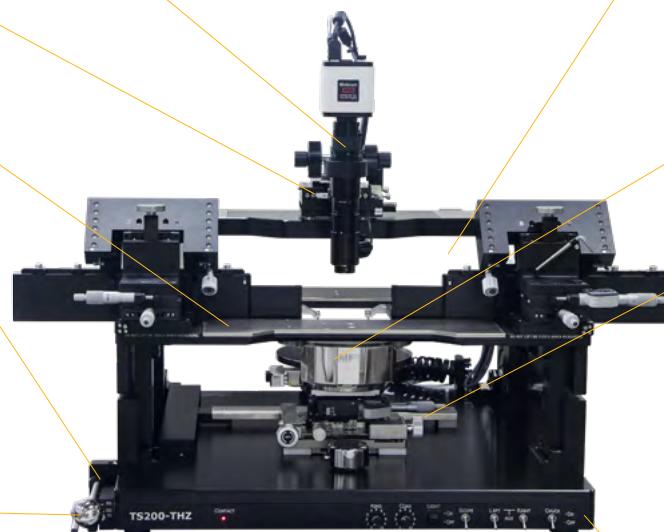
- ユニークなオーバートラベル・コントロール (オプション)
- 正確なマルチTRL校正のためのMP80-DX (オプション)
- ラージエリア MP80 マイクロポジショナを2つのボルトダウンで取付

自動インピーダンス チューナの取付

- 最適なチューニング範囲および最大のΓ (反射係数) を提供

その他のオプション

- 防振台
- モニタースタンド
- 計測器用棚



周波数エクステンダ取付モジュール

- 簡単なセットアップおよび周波数バンドの切替が容易なダブル型インターフェース
- 導波管プローブを直接取付ることにより、DUTに近いところに搭載可能。Sバンド不要
- ミリ波帯での安定測定をチャックの高さを上げることなく実現
- 導波管または同軸アプリケーション用オプション
- 汎用ラージエリア・プラットフォームにより種々の周波数エクステンダを組み可能。最高1.1 THzまでのエクステンダに対応
- 導波管プローブの微調整用マイクロメータ・スクリュー

モジュラーチャック

- RF および ミリ波測定に特化した設計
- 予算節約の為の フィールド・アップグレード・キット
- 簡単な操作で通常ウエハ、小型ウエハの切り替え

チャックXYZ ステージ移動

- 片手操作が可能なユニークなパックコントロール型エアーベアリング機構
- X-Yステージの移動範囲は255 x 325 mm でデバイスの搭載が用意
- 25 x 25 mmの範囲で、マイクロメータ・コントロールによる1 μm の高分解能移動可能
- チャックθは+/-5°の範囲で調整可能
- チャックのZ移動範囲は10 mm、分解能は1.0 μm の高分解。デジタル表示の採用により、正確なオーバトラベル設定可能
- XYエアベアリング・ステージのコンタクト時の安全コンタクト・ロッキング機構
- X, Y独立したロッキング機構
- 安定性を保証する大型真空ベース

前面バキューム・コントロール

- 使いやすい
- 表示が明確

RF キャリブレーション

- 校正基板用に2 つの補助チャック
- 正確なRF測定用にセラミック使用
- 1 μm の平坦性によりコンタクト精度の保証
- QAlibia® - RF 校正用ソフトウェア

ThermoShield™

- フルサイズ200 mm対応の ThermoShield™
- IC測定用の25 mm温度チャック